



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 882190
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ G 01 N 21/86
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 10.05.88
(23) Alkupäivä—Löpdag
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 25.08.89
(86) Kv. hakemus—Int.ansökan
(30) Etuoikeus—Prioritet 24.02.88 US 159830

(71) Hakija/Sökande: *Albany International Corp.*, One Sage Road, Menands, New York, USA

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Bolton, Joseph A. 2. Harbaugh, Steven K.

(74) Asiamies/Ombud: Papula Rein Lahtela

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Menetelmä ja laite materiaalirainan analysoimiseksi. Förfarande och anordning för analysering av en materialbana.

(57) TIIVISTELMÄ

Menetelmä ja laite materiaalirainan rakenneprofiilin muodostamiseksi reaaliajassa koko sen leveydeltä rainan kulkiessa valonlähteen ja kameran välistä ja kameran muodostaessa signaaleja, jotka vastaavat valon intensiteettiä rainan koko leveydellä verrattuna yksipiste tai näytemittauksiin. Sen jälkeen nämä signaalit käsitellään muodostamaan reaaliajassa rainan rakenneprofiili sen koko leveydeltä.

(57) SAMMANDRAG

Förfarande och anordning för bildande av en strukturprofil av en materialbana i realtid över hela dess bredd när banan löper mellan en ljuskälla och en kamera och kameran bildar signaler, som motsvarar ljusintensiteten över banans hela bredd i jämförelse med enpunkts- eller provmätningar. Efter detta behandlas dessa signaler för bildande av banans strukturprofil i realtid över hela dess bredd.

